

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年1月17日(2022.1.17)

【公開番号】特開2021-106279(P2021-106279A)

【公開日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【年通号数】公開・登録公報2021-032

【出願番号】特願2021-50585(P2021-50585)

【国際特許分類】

H 01 L 21/677(2006.01)

10

B 65 G 49/07(2006.01)

H 01 L 21/027(2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 A

B 65 G 49/07 C

H 01 L 21/30 562

【手続補正書】

【提出日】令和4年1月5日(2022.1.5)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板が格納される搬送容器が夫々載置される複数のロードポートと、
前記基板に対して処理を行う処理部と、

前記処理部に対して前記基板を受け渡すために設けられ、前記処理部による処理前の基板
、処理後の基板の各々が載置される受け渡しモジュールと、

前記基板を搬入出するための搬送口を有し、前記処理部による処理前あるいは処理後の前
記基板を検査する検査モジュールと、

前記複数のロードポートに載置される前記各搬送容器と、前記受け渡しモジュールと、前
記検査モジュールと、の間で基板を搬送する基板搬送機構と、

前記基板搬送機構による前記基板の搬送領域を囲む筐体と、
を備え、

前記搬送口は前記搬送領域に開口し、前記筐体の外部において前記複数のロードポートと
前記検査モジュールとが左右方向に並ぶことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記検査モジュールは、前記複数のロードポートに各々載置される前記搬送容器と同じ
高さに設けられている請求項1記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記検査モジュールは複数設けられ、
当該複数の検査モジュールは、前記複数のロードポートの前記搬送容器よりも高い位置
に設けられる検査モジュールを含むことを特徴とする請求項1または2に記載の基板処理
装置。

【請求項4】

前記検査モジュールの少なくとも一部は前記筐体から突出し、
当該検査モジュールは、前記基板処理装置に対して着脱自在であることを特徴とする請求
項1ないし3のいずれか一つに記載の基板処理装置。

50

【請求項 5】

前記複数のロードポートと前記検査モジュールとが左右方向に並ぶことでなす列について、当該検査モジュールが前記列の端部に位置することを特徴とする請求項 1ないし 4のいずれか一つに記載の基板処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明の基板処理装置は、基板が格納される搬送容器が夫々載置される複数のロードポートと、

前記基板に対して処理を行う処理部と、前記処理部に対して前記基板を受け渡すために設けられ、前記処理部による処理前の基板、処理後の基板の各々が載置される受け渡しモジュールと、

前記基板を搬入出するための搬送口を有し、前記処理部による処理前あるいは処理後の前記基板を検査する検査モジュールと、

前記複数のロードポートに載置される前記各搬送容器と、前記受け渡しモジュールと、前記検査モジュールと、の間で基板を搬送する基板搬送機構と、

前記基板搬送機構による前記基板の搬送領域を囲む筐体と、
を備え、

前記搬送口は前記搬送領域に開口し、前記筐体の外部において前記複数のロードポートと前記検査モジュールとが左右方向に並ぶことを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

30

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【補正の内容】

40

50